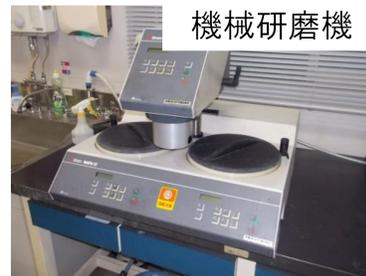


断面微細組織の観察・分析技術高度化のための試料作製技術の確立

事業目的

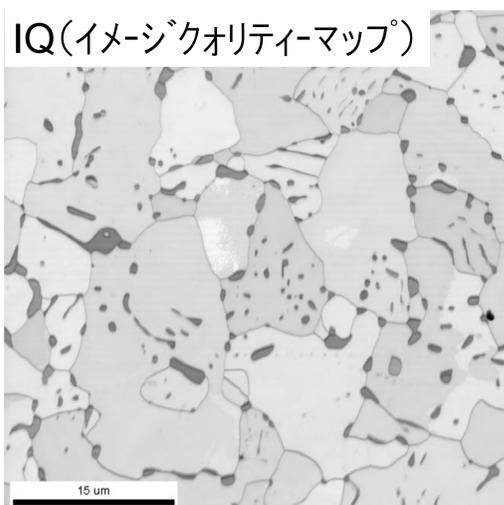
高度電子材料の開発・品質管理に必須となる断面微細組織観察を適切に行うため、**目的に応じた断面作製技術**の開発と**電子線後方散乱回折(EBSD)**による**組織評価手法**を組み合わせ、製品開発の支援を行います。



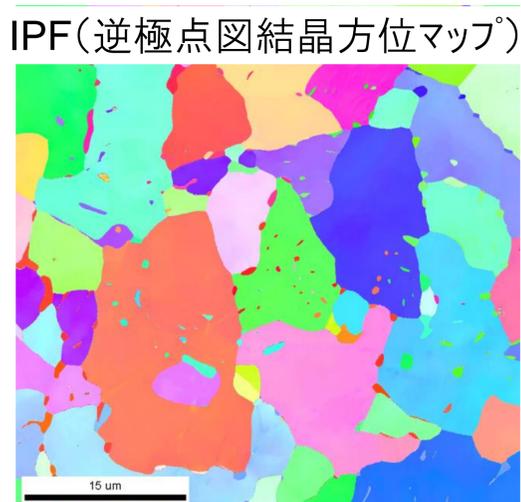
実施例

1) S45C 750°C 10hr 保持

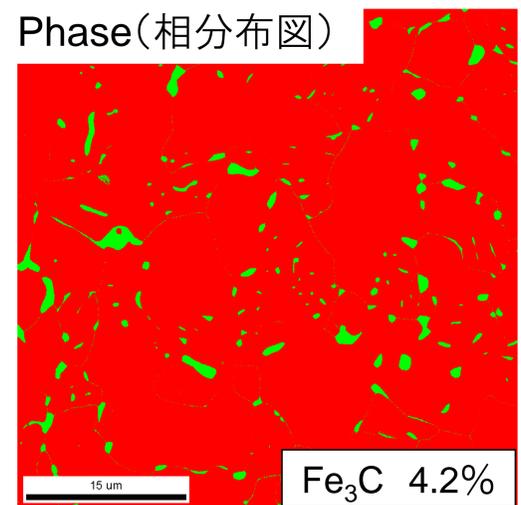
球状 Fe_3C 相の分布割合を定量



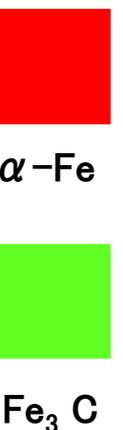
EBSDパターンの良し悪しを表示



結晶面の面指数を表示

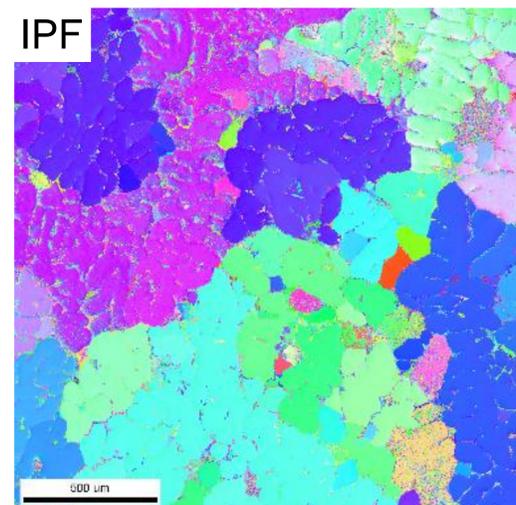
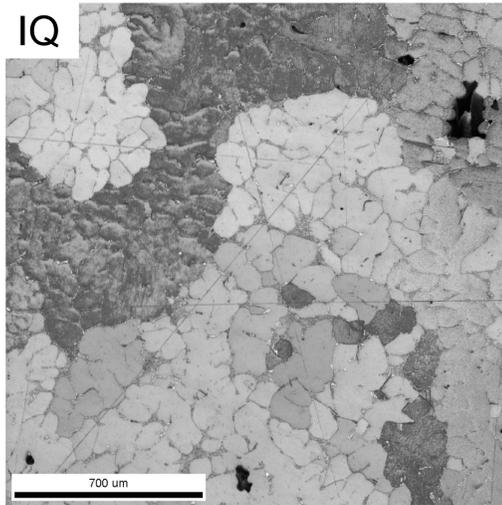
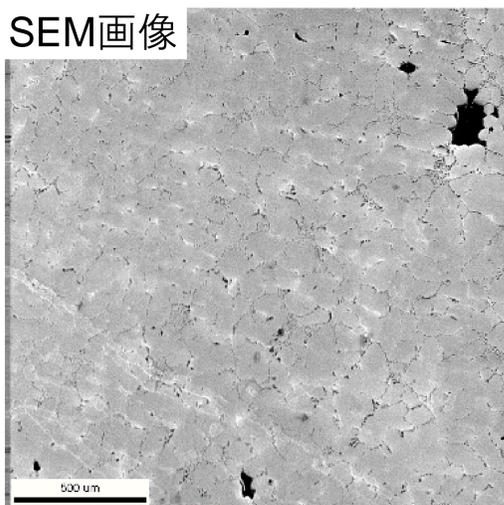


結晶系で判別した結晶相を表示



2) Al 鋳物

デンドライト組織の正確な評価



当センターにて、試料の断面作製及び評価を支援します